2025年度 武田SCRセミナー

ULVACドライエッチングセミナー

■ 日時: 2025年10月9日(木) 15:00-16:30

■ 場所: 東京大学 武田先端知ビル1階 102号セミナー室

(アクセス: https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html)

+Zoomによるハイブリッド形式

■ 講師: (株)アルバック 半導体電子事業本部 上村隆一郎様

同 先進技術研究所 半導体応用技術 谷野健太様

■ 参加対象者:エッチング技術に関心がある方

※同業他社の方はお断りをさせていただく場合があります

■ 定員: 40名(現地)+300名(オンライン)

■ 参加費: 無料

■ 申し込み: https://forms.gle/vbL8e4ovK6shX1Fx5

申し込み用 QRコード

■ 締め切り: 2025年10月6日(月)※定員になり次第、締め切らせていただきます

- 講演内容 -

(本講演は日本語のみとなります)

- 1. アルバックのエッチング源の原理と特徴(ICP, NLD, RIE)
- 2. 最近のエッチングのトレンドと加工例紹介
- 3. 最新のアルバックエッチング装置のご紹介
- 4. 質疑応答
- ※録画はご遠慮ください
- ※ 上記agendaは予告なしで変更する場合もございますので予めご了承願います。
- ※ 個別のprocess相談、お困り事のご相談については別途対応いたしますので、当日会場のアルバック担当者までご連絡、リクエストください。

アルバック販売(株) 第1営業部 内藤将太様 同 第3営業部 松澤久博様

お問い合わせ: 東京大学 ナノテク支援室 Tel: 03-5841-1506 (内線21506)





